

ICTF-15 発表募集

会議名：第15回薄膜国際会議

英語名：15th International Conference on Thin Films; ICTF-15

ウェブサイト：<http://ictf15.jp/>

会 期：2011年11月8日（火）～11日（金）

開催場所：京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町70）

<http://www.kyoto-terrsa.or.jp/>

主催団体名：一般社団法人 日本真空協会（The Vacuum Society of Japan (VSJ)）

後援団体名：International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA)

問合せ先：ICTF-15事務局

株式会社インターグループ内

〒450-0002 名古屋市東区中村区名駅2-38-2 オーキッドビル8F

電話：052-581-5300 Fax：052-581-5585

E-mail：ictf15@intergroup.co.jp

会議概要：ICTFは、三年に一回、IUVSTAの薄膜部門（TFD）が後援して開催する薄膜に関する国際会議である。本ICTF-15は、薄膜研究の最先端で活躍する研究者や技術者を世界中から広く募集・招聘し、横断的研究交流を図ることを目的とする。本会議は、薄膜研究の基礎から応用まで網羅したトピックからなり、全参加者数は600人以上となる見込みである。トピックは以下のとおりである。

■トピック

[T1] Fundamentals of Thin Film Growth and Epitaxy

- Real time thin film growth studies
- Surface chemistry of structure formation in multi-component thin films
- Surface chemistry for thin films
- Self organized growth
- Dynamics and reaction kinetics of thin film growth
- Biosurfaces and biointerfaces related to thin film growth

[T2] Nanostructured Growth

- Growth on templated surfaces
- Growth of nanowires and nanorods
- Micro- and nano-architectures and functions
- Formation of micro- and nano-templates

[T3] Advances in Deposition Techniques

- Physical vapor deposition (PVD)
- Chemical vapor deposition (CVD)
- Atomic layer deposition (ALD)
- High power impulse magnetron sputtering (HIPIMS)
- Functional films on unheated substrates and flexible substrates
- Plasma processing for thin film processing
- Wet processing

[T4] Modelling and Computer Simulation

- Modeling of thin film growth
- Computer simulation for thin films

[T5] Characterization and Instrumentation

- Focused ion beams used to modify and analyze surface and interface
- Application of scanning probe techniques
- In situ real time techniques
- Imaging

[T6] Organic Thin Films

- Organic thin film growth
- Self-assembled monolayers (SAMs) and multilayers
- Organic nanomaterials with flexible structure and devices
- Conducting polymers
- Advanced liquid crystalline materials
- Properties of organic thin films

[T7] Applications of Thin Films

- Photonics
- Solar cells
- Optical devices
- Batteries
- Gas barriers
- Sensors
- Magnetic and spintronics devices
- Dielectric and ferroelectric devices
- Hard coatings
- Sustainable energy
- Data storage
- Microelectronics
- Nitride and III-V semiconductors
- Silicon and germanium based semiconductors
- Oxide films
- Transparent conducting films

[T8] Thin Films for Future Industries

- Thin films for bio-medical industries
- Thin films for automobile and aerospace industries
- Thin films for electronic industries
- Thin films for energy industries

アブストラクト提出：ウェブサイトからの提出 (<http://ictf15/>)。フォーマットはウェブサイトに記載 (A4 サイズ用紙 1 ページ)。

アブストラクト提出締切：2011年 5 月 9 日 (月)。採択に関する連絡は 6 月 30 日 (木) までに実施。

プロシーディングスの刊行：国際学術誌 “Journal of Physics: Conference Series” にて刊行予定 (投稿論文ページ数：一般講演論文 4-6 ページ, 招待講演論文 4-10 ページ, 詳細はウェブサイトにて案内)。

参加費：登録はウェブサイトより行う。

事前登録 (2011年 8 月 31 日 (水) 締切)

(一般) 40,000円 (学生) 15,000円

事後登録 (2011年 9 月 1 日 (木) 以降)

(一般) 45,000円 (学生) 20,000円

同伴者 10,000円

レセプション 8,000円

ホテル予約：予約はウェブサイトより行う。

本国際会議開催時期は観光シーズンのため、京都市内のホテル予約が困難になります。特に今年は、同時期に大きな宗教行事が予定されており、ホテル予約がより一層難しくなることが予測されています。お早めにホテル予約をお願いいたします。

組織委員会：

組織委員長：高井 治 (名古屋大学教授)

事務局長：齋藤永宏 (名古屋大学教授)

電話：052-789-4699 Fax：052-789-4998

E-mail saito@nagoya-u.jp